タングステンナノ構造のマルチスケールシミュレーション

Multi-scale Simulation for Tungsten Nano-structure

伊藤篤史¹, 高山有道¹, 吉本芳英², 斎藤誠紀³, 中村浩章^{1,3} Atsushi M. ITO¹, Arimichi TAKAYAMA¹, Yoshihide YOSHIMOTO², Seiki SAITO³, and Hiroaki NAKAMURA^{1,3}

> 核融合研¹, 鳥取大工², 名大工³ NIFS¹, Tottori Univ.², Nagoya Univ.³

近年は磁場閉じ込め型核融合炉のダイバー ター板や第一壁として、タングステン材料が盛 んに用いられている。中でも、ITERにおけるダ イバーター板として炭素材料の使用フェーズ を全てタングステン材料の使用フェーズへと 変更することなどが現在検討されており、タン グステン材料のプラズマ対向性の研究が非常 に重要な時期となっている。さて、このタング ステン材料はヘリウム照射を受けることで、バ ブル状[1]や髭状(ファズ)[2,3]のナノ構造がで きることが実験から報告されている。これらの ナノ構造の形成はタングステンのプラズマ対 向性に大きな影響を与えると同時に、産業応用 の可能性も持ち合わせており、非常に興味深い 現象である。最近では、ヘリウム以外の希ガス によるナノ構造の形成の可能性の調査報告[4] や、タングステンの代わりに鉄を用いてバブル 構造を作成した報告[5]もあり、実験は盛んに行 われている。一方でナノ構造の形成に関する理 論的研究は少なく、形成メカニズムは良くわか っていない。我々は複合的な材料シミュレーシ ョン手法を組み合わせて[27E32P]ナノ構造の形 成メカニズムの解明を目指している。

さて、タングステンナノ構造の形成は、次の 三段階の過程に分解できると我々は考えてい る。まず、表面からの希ガスの入射過程である。 拡散による内部への侵入の前には、入射による 直接的な飛程として少なくとも金属格子数層 分(1nm程度)の侵入が必要である。金属と希 ガスの組み合わせでは、入射による1nmの侵入 に、場合によっては数+eVの入射エネルギーが 必要となる。一方であまりエネルギーが高いと スパッタリングによって表面が削れてしまい ナノ構造の形成を阻害する。この観点から、金 属と希ガスの組み合わせに毎に、入射による有 効な侵入が可能かどうかを議論することがで きる。この見積もりはAC∀TコードによるBCA 計算によって行うことができる[6]。 次に十分に侵入した希ガスがバブルを形成 するためには、金属中で自己集合を起こさなけ ればならない。この拡散による自己集合過程は、 金属中の空孔による希ガスの捕獲エネルギー を計算することで議論する。すならち、空孔を 基点に希ガス原子は集合した方が安定なのか、 ばらばらに存在した方が安定なのかを問う。こ れには非常に正確な計算が必要であり、我々は 密度汎関数法による量子化学計算によって捕 獲エネルギーを見積もった[7,30E28P]。

最後に、自己集合した1nm以下の希ガスの塊 が10nmから100nm程度の構造へと成長してい く過程がある。この現象は、数eV程度のエネル ギースケールの現象なのでBCAでは扱えず、ま た空間スケールが大きいためDFTでも到底計算 できない。よって、MDによる取り扱いとなる が、時間スケールが非常に大きい現象の為に通 常のMDでは当然追いきれない。我々は、まず タングステンと希ガス系に向けた、MDのポテ ンシャルモデルを開発した。そこでは、ダウン フォールディング法[8]を用いて、自動生成され たサンプル構造に対してDFTとのエネルギー差 が最小になるように、ポテンシャルモデルの最 適化を行った[9]。さらにこれを用いて大規模並 列化を行ったMDコードの開発を行う。さらに、 時間スケールを短縮して構造変化を取り扱う 拡張アンサンブル系のMDの導入に取り組み、 ヘリウムの成長過程の再現に挑戦する。

- [1] H. Iwakiri, et al., J. Nucl. Mater. 283-287 (2000) 1134.
- [2] S. Takamura, et al., Plasma Fusion Res.: Rapid Communications, **1** (2006) 051.
- [3] S. Kajita, et al., Nucl. Fusion, 47 (2007) 1358.
- [4] M. Yajima, et al., J. Plasma Sci. Tech., accepted.
- [5] M. Tokitani, et al., J. Nucl. Mater. **329-333** (2004) 761.
- [6] S. Saito, et al., PSI 2012, P2-78.
- [7] A. Takayama, et al., Jpn. J. Appl. Phys., accepted.
- [8] Y. Yoshimoto, J. Chem. Phys., 125, (2006) 184103.
- [9] A. M. Ito, et al. PSI 2012, P2-66.